

## 第 2 回 地域セミナー

### 「透過電子顕微鏡における最新ソフトウェア入門」

透過電子顕微鏡による微細構造解析では、様々なソフトウェアを用いることにより、さらに進んだ評価が可能になります。本セミナーでは、著名な研究者・開発者に最新のソフトウェアの紹介をお願いしました。ふるってご参加いただきますようご案内申し上げます。

**日 時：2013年10月25日(金)13:30～17:00**

**場 所：NIMS 千現地区 第1会議室**

**参加費：無料**

**意見交換会：2,000円**

## プログラム

**座長 原徹**

➤13:30-13:40

藤田大介 (NIMS 微細構造解析プラットフォーム長)  
挨拶

➤13:40-14:00

木本浩司 (NIMS)  
電子顕微鏡用の最新ソフトウェア群の概要

➤14:00-14:30

三留正則 (NIMS)  
電子顕微鏡像シミュレーションの実際と注意点

➤14:30-15:00

Jacob Wilbrink (Gatan Inc.)  
New Developments in Gatan's DigitalMicrograph

➤15:00-15:20

休憩 (20分)

**座長 三留正則**

➤15:20-15:50

鈴木実 (サーモフィッシャーサイエンティフィック(株))  
EDS 面分析の最新手法：多変量イメージ解析 (COMPASS)

➤15:50-16:20

古河弘光 (SYSTEM IN FRONTIER INC.)  
最新の電子顕微鏡用アプリケーションソフトウェア  
～画像収録から三次元再構成まで～

➤16:20-16:50

石塚和夫 (HREM Research Inc.)  
DigitalMicrograph による電顕データ解析

➤16:50-17:00

休憩 (10分)

➤17:00-

意見交換会 (千現地区食堂)



参加申込みはこちらから：<http://www.nims.go.jp/nmcp/>  
問い合わせ：[nmcp@nims.go.jp](mailto:nmcp@nims.go.jp)